

0.4; 09

© 1993

## ТОНКАЯ АНТЕННА С ПЛАЗМЕННОЙ НАГРУЗКОЙ

Г.А. М а р к о в, А.Л. У м н о в, М.В. Л и х о д е е в

В связи с проблемой повышения эффективности электрических вибраторов определенный интерес представляют возможности оперативного управления их входными и излучательными характеристиками с помощью плазменных образований, формируемых полем антенны [1-6]. В настоящей работе приводятся результаты экспериментального исследования влияния стационарной плазменной нагрузки, формируемой полем рабочего сигнала на конце тонкой антенны ( $\alpha \ll l_0 \sim \lambda$ ;  $\alpha$ ,  $l_0$  – радиус и длина вибратора,  $\lambda$  – длина волны в вакууме), на величину и распределение излучательного тока.

Схема эксперимента представлена на рис. 1. Исследовалась антenna, представлявшая собой несимметричный металлический вибратор ( $l_0 = 180$  см), расположенный над металлическим щитом, конец вибратора ( $l_1 = 40$  см) помещался в разрядный баллон ( $L_0 = 1.5$  м,  $d = 20$  см), нужное давление в котором ( $P = 1-10^{-2}$  Тор) устанавливалось при помощи непрерывной откачки воздуха. Излучатель имел индуктивную связь с ВЧ генератором, сигнал которого создавал и поддерживал плазму вокруг конца антенны. О влиянии плазменной нагрузки на характеристики тонкой антенны можно было судить по распределению тока вдоль антенны. Токораспределение снималось с помощью датчика магнитного поля, представляющего собой одновитковую проволочную рамку ( $r = 2$  мм). При измерениях датчик перемещался вдоль открытой части антенного провода на фиксированном расстоянии от его оси. Сигнал с датчика регистрировался на осциллографе. Параметры плазмы измерялись с помощью ленгмюровского зонда. Влияние концевой нагрузки на антенный ток изучалось при неизменном выходном напряжении ВЧ генератора на трех фиксированных частотах (50, 180, 230 МГц) при различных давлениях в разрядном баллоне. При давлении  $P \geq 5 \cdot 10^{-1}$  Тор плазменная неоднородность представляла собой яркосветящуюся пленку, окружавшую конец антенны. После снижения давления до  $2 \cdot 10^{-1}$  Тор на конце антенны формировался плазменный шар, а при наличии на антenne второй пучности поля и  $P \sim 5 \cdot 10^{-2}$  Тор в районе этой пучности появилось еще одно плазменное образование. При дальнейшей откачке воздуха ( $P \sim 10^{-2}$  Тор) плазменные образования сливались в одно, и плазма заполняла весь разрядный баллон.

На рис. 1 и 2 представлены результаты измерений распределений тока вдоль антенны. На частоте 50 МГц (рис. 1) после зажигания разряда происходило увеличение значения амплитуды тока в

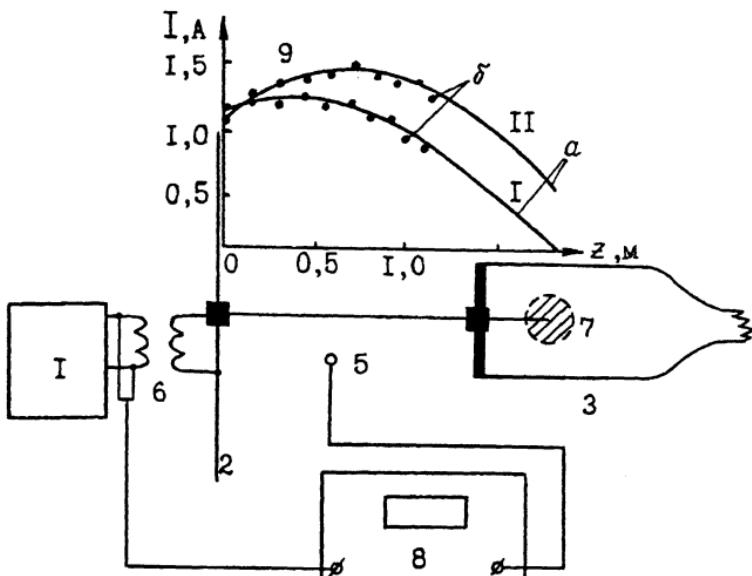


Рис. 1. Схема эксперимента: 1 - ВЧ генератор, 2 - металлический лист, 3 - разрядный баллон, 4 - антенна, 5 - датчик тока, 6 - емкостной делитель, 7 - плазменная неоднородность, 8 - осциллограф, 9 - распределение тока вдоль антенны при  $f=50$  МГц (I - без плазмы, II - с плазменной нагрузкой при давлении 0.3 Тор; а - теория, б - эксперимент).

пучности, обусловленное подстройкой резонансной частоты антенны под частоту возбуждающего сигнала. При этом координата пучности антенного тока смешалась к свободному концу антенны, что свидетельствовало о емкостном характере образовавшейся плазменной нагрузки. Для коротких вибраторов ( $l_o < \frac{\lambda}{2}$ ) изменение плазменной нагрузкой граничных условий на конце вибратора ведет к увеличению его действующей длины (рис. 1), что также, как и возрастание антенного тока, увеличивает излучаемую мощность. Как оказалось, для антенн, размеры которых сравнимы с длиной волны (что имело место, например, на частоте 230 МГц (рис. 2)), образование плазменной нагрузки могло обеспечивать работу антенны и в режиме, близком к режиму стоячей волны (кривая II), и в режиме бегущей волны (кривая III). При этом концевая плазменная нагрузка улучшала согласование антенны с источником сигнала, что могло вести к возрастанию амплитуды тока в пучности (кривая II) или к увеличению амплитуды волны тока, распространяющейся к концу антенны (кривая III). Направление смещения пучности тока в рассматриваемом случае указывает на индуктивный характер мнимой части импеданса нагрузки. Изменение КБВ антенного тока связано с наличием у импеданса нагрузки реальной части, обусловленной потерями в плазме. Эффекты автосогласования, наблюдавшиеся на частоте 180 МГц, были аналогичны описанным выше.

Анализ работы тонкой антенны с плазменной нагрузкой на конце (при условии  $a \ll l_o$ ,  $a \ll \lambda$ ;  $l_n, b_n \ll \lambda$ , где  $l_n, b_n$  - ха-

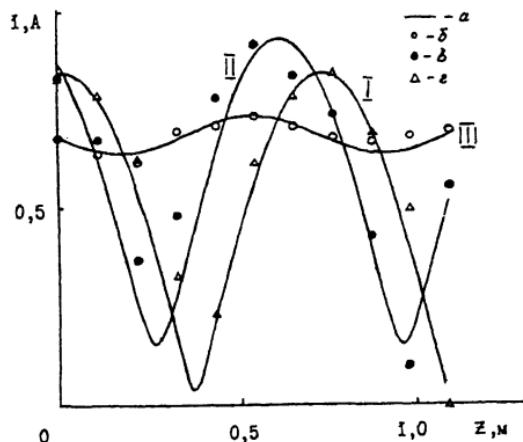


Рис. 2. Токораспределение в антенне на частоте 230 МГц: без нагрузки при атмосферном давлении (I); с плазменной нагрузкой при  $p = 0.2$  Тор (II) и  $p = 0.7$  Тор (III). а – теория, б, в, г – эксперимент.

рактерные продольный и поперечный размеры плазменной неоднородности) можно провести, опираясь на модель нагруженной длинной линии, в рамках метода эквивалентных схем [4]. При этом параметры схемы замещения следующие:  $l$  – длина отрезка линии, равная длине плеча вибратора,  $Z_B = 60 \left( \ln \left( \frac{\lambda}{\pi a} \right) - 0.58 \right)$  – ее волновое сопротивление,  $h = \beta - \alpha$  – постоянная распространения, где  $\beta = \frac{2\pi}{\lambda}$ ,  $\alpha = \frac{R_1}{Z_B}$ ,  $R_1$  – погонное сопротивление провода линии, рассчитанное из условия равенства потерь на излучение омическим потерям в линии. Токораспределение в эквивалентной длинной линии с комплексной нагрузкой  $Z_H$  на конце описывается формулой:

$$|I| = |I_0| \left| 1 - \frac{\frac{Z_H}{Z_B} - 1}{\frac{Z_H}{Z_B} + 1} \exp(2ih(l-z)) \right|. \quad (1)$$

Для оценки импеданса плазменной нагрузки ( $b_n < l_n \ll \lambda$ ,  $n_e$  – средняя концентрация плазмы) воспользуемся формулой:  $Z_H = \frac{1}{l_n} \int E(r) dr$ ,

где  $I_\alpha$  – амплитуда тока в проводе, окруженному плазмой,  $a$  – радиус провода,  $r$  – расстояние от оси,  $E(r)$  – радиальная компонента электрического поля. При этом  $\epsilon \epsilon_0 E = \frac{I_\alpha}{2\pi i \omega l_n r}$ , где

$\varepsilon = 1 - \frac{\omega_p^2}{\omega(\omega - i\nu_m)}$ . Отсюда имеем:

$$Z_H = - \frac{i}{2\pi\varepsilon_0\omega l_H} \left( \frac{\ln\left(\frac{b_H}{a}\right)}{1 - \frac{\omega_p^2}{\omega(\omega - i\nu_m)}} + \ln\left(\frac{l_H}{b_H}\right) \right), \quad (2)$$

где  $\omega_p$  – плазменная частота,  $\nu_m$  – частота столкновений электронов с молекулами. На рис. 2 представлены распределения тока в антenne, рассчитанные по формуле (1); при этом средняя концентрация плазмы бралась близкой к измеренной локально, но так, чтобы обеспечить наилучшее совпадение рассчитанной формы тока с полученной экспериментально. Например, при  $f = 230$  МГц,  $l_H = 10$  см,  $b_H = 5$  см,  $p = 0.4$  Тор,  $a = 0.1$  см,  $n_e = 2 \cdot 10^9$  см<sup>-3</sup> оценка по формуле (2) дает  $Im(Z_H) \ll Re(Z_H) \approx 400$  Ом  $\approx Z_B$ , при этом устанавливается режим, близкий к режиму бегущей волны, что наблюдалось и экспериментально (рис. 2, кривая Ш).

Таким образом, в антenne с плазменной нагрузкой на конце выбором условий разряда может быть осуществлено управление распределением излучающего тока, а следовательно, ее входным импедансом и излучательной мощностью.

### Список литературы

- [1] Ким А.В., Марков Г.А., Смирнов А.И., Умнов А.Л. // Письма в ЖТФ. 1989. Т. 15. В. 5. С. 34–35.
- [2] Aitshuler S. US Patent. N 4. 1986. 633. 263.
- [3] Марков Г.А., Умнов А.Л., Лиходеев М.В. Сб. докл. Междунар. науч. техн. конф. „Актуальные проблемы фундаментальных наук“ СССР. Москва, 1991. С. 46–49.
- [4] Марков Г.Т., Сазонов Д.М // Антенны. М.: Энергия, 1975. 528 С.
- [5] Марков Г.А., Умнов А.Л., Лиходеев М.В. Науч. конф. по радиофизике. Нижний Новгород, 1992. Матер. конф. С. 15–16.
- [6] Messiaen A.M., Vandenplas P.E. // Electron. Letters. 1967. V. 3. N 1. P. 26–27.
- [7] Messiaen A.M., Vandenplas P.E. // Electron. Letters. 1968. V. 4. N 2. P. 29–31.